BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

101 04 373.2

Anmeldetag:

1. Februar 2001

Anmelder/Inhaber:

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Traunreut/DE

Bezeichnung:

Verfahren zur Funktionskontrolle einer Positionsmesseinrichtung und Positionsmesseinrichtung

zur Durchführung des Verfahrens

Priorität:

6.12.2000 DE 100 60 572.9

IPC:

G 01 B 21/02

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 19. September 2001

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

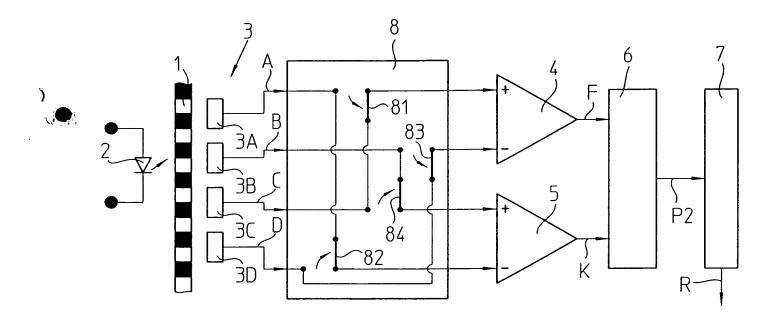
Niethan

Zusammenfassung

Verfahren zur Funktionskontrolle einer Positionsmesseinrichtung und Positionsmesseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Zur Funktionskontrolle einer inkrementalen Positionsmesseinrichtung wird aus den Abtastsignalen (A, B, C, D) durch Interpolation ein Positionsmesswert (P1) gebildet. Erfindungsgemäß wird in einem zweiten Schritt aus den vorhandenen Abtastsignalen (A, B, C, D) ein weiterer Positionsmesswert (P2) synthetisch gebildet, indem der Interpolationseinheit (6) die Abtastsignale (A, B, C, D) in einer anderen Verknüpfung zugeführt werden. Die beiden Positionsmesswerte (P1, P2) werden miteinander verglichen und in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses wird ein Fehlersignal (R) abgegeben (Figur 1b).

5



_) _

Verfahren zur Funktionskontrolle einer Positionsmesseinrichtung und Positionsmesseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Positionsmesseinrichtungen werden in Form von Winkel- und Längenmesseinrichtungen in der Werkzeugmaschinenindustrie und in anderen Fertigungs-, Handhabungs- und Prüfsystemen breit eingesetzt. Für alle Einsatzfälle gewinnt vermehrt eine hohe Funktionssicherheit an Bedeutung, da ein Fehlbetrieb erhebliche Schäden hervorrufen kann. Es gibt bereits mehrere Lösungsvorschläge, um mittels Überwachungstests eine rechtzeitige Fehlererkennung der Positionsmesseinrichtung zu erhalten und damit Folgeschäden abzuwenden.

In der DE 28 25 842 C2 und der US 3,725,904 ist ein Verfahren sowie eine Einrichtung zur Überwachung der Richtigkeit des erfassten Positionsmesswertes beschrieben. Zur Abtastung einer Codierung bzw. Teilung sind zwei um einen vorgegebenen Abstand zueinander versetzt angeordnete Abtasteinheiten vorgesehen. Die zwei Positionsmesswerte der beiden Abtasteinheiten werden miteinander verglichen und eine Positionsdifferenz gebildet. Diese gemessene Differenz der Positionsmesswerte wird mit der durch die geometrische Anordnung der Abtasteinheiten vorgegebene Solldifferenz

verglichen und in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses wird ein Fehlersignal ausgegeben.

Diese Maßnahme hat den Nachteil, dass eine redundante Abtasteinheit erforderlich ist, was die Baugröße und den Bauteileaufwand erhöht.

Bei der Positionsmesseinrichtung gemäß der DE 40 09 749 A1 ist zur Funktionskontrolle nur eine Abtasteinheit erforderlich. Die Abtasteinheit wird zur Durchführung des Prüfverfahrens um einen durch Anschläge fest vorgegebenen Weg verfahren und der dabei gemessene Weg wird mit dem durch die Anschläge vorgegebenen Weg verglichen. Bei einer Abweichung wird ein Fehlersignal erzeugt.

10

15

20

25

30

Der Nachteil dieser Maßnahme ist das Vorsehen von mechanischen Anschlägen und das Vorsehen eines zusätzlichen Antriebs, was die Baugröße erheblich vergrößert.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Funktionskontrolle einer Positionsmesseinrichtung anzugeben, das einfach durchführbar ist und das die Baugröße der Positionsmesseinrichtung nicht bzw. nur unwesentlich vergrößert.

Diese Aufgabe wird durch das im Anspruch 1 angegebene Verfahren gelöst. Die Positionsmesseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist im Anspruch 5 angegeben.

Durch die erfindungsgemäßen Maßnahme kann auf einfache Weise eine Fehlfunktion der Detektorelemente der Abtasteinheit sowie Fehlfunktionen der elektrischen Bauteile in den einzelnen Abtastkanälen, insbesondere der Verstärker und Trigger erkannt werden.

Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung entnimmt man den abhängigen Ansprüchen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen

20

25

30

5		
	Figur 1a	ein erstes Ausführungsbeispiel einer Positi- onsmesseinrichtung in einem ersten Kontroll- zustand,
10	Figur 1b	die Positionsmesseinrichtung gemäß Figur 1a in einem zweiten Kontrollzustand;
15	Figur 2a	eine weitere Positionsmesseinrichtung in einem ersten Kontrollzustand und
	Figur 2b	die weitere Positionsmesseinrichtung in einem zweiten Kontrollzustand.

In den Figuren 1a und 1b ist ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Positionsmesseinrichtung besteht aus einer lichtelektrisch abtastbaren Teilung 1, die von einer Lichtquelle 2 beleuchtet wird und von einer Abtasteinheit 3 zur Erzeugung von positionsabhängigen elektrischen Abtastsignalen A, B, C, D abgetastet wird. Die Teilung 1 ist eine inkrementale, also periodische Markierung, so dass das von der Lichtquelle 2 ausgesandte Licht periodisch moduliert auf gegeneinander versetzt angeordnete Detektorelemente 3A, 3B, 3C, 3D der Abtasteinheit 3 trifft und analoge sinusförmige Abtastsignale $A = a + \sin\alpha$; $B = a - \sin\alpha$; $C = a + \cos\alpha$; $D = a - \cos\alpha$ erzeugt werden. In bekannter Weise sind die periodischen Abtastsignale A, B, C, D gegeneinander jeweils um 90° phasenverschoben, mit der Phasenlage A = 0°, B = 180°, C = 90°, D = 270°.

Zur Eliminierung des Gleichlichtanteils a sind die gegenphasigen Abtastsignale A, B und C, D jeweils in Differenz geschaltet, wozu Differenzverstärker 4, 5 vorgesehen sind, an deren Ausgang die Differenzsignale E = A - B =

5

10

15

20

25

30

sina und $F = C - D = \cos \alpha$ anstehen. Diese Differenzsignale E und F werden einer Auswerteeinheit in Form einer Interpolationseinheit 6 zugeführt, welche aus der Phasenlage der Differenzsignale E, F in bekannter Weise einen absoluten Positionsmesswert P1 innerhalb einer Periode der periodischen Differenzsignale E, F bildet und diesen in einer Vergleichseinrichtung 7 abspeichert. Dieser Betrieb der Positionsmesseinrichtung ist in Figur 1a dargestellt.

Der absolute Positionsmesswert P1 wird in der Interpolationseinheit 6 beispielsweise nach der Beziehung P1 = arctan E/F berechnet. Die Interpolation kann aber auch durch Auslesen von Tabellenwerten erfolgen.

Zur Funktionskontrolle der Positionsmesseinrichtung ist eine Umschalteinrichtung 8 vorgesehen, welche die Abtastsignale A, B, C, D in einer anderen Verknüpfung an die Interpolationseinheit 6 anlegt. Dieser Zustand ist in Figur 1b dargestellt. Mittels der Schalter 81, 82, 83, 84 werden die Abtastsignale A, B, C, D an andere Eingänge der Differenzverstärker 4, 5 gelegt, so dass vom Differenzverstärker 4 das Differenzsignal F = C - D und vom Differenzverstärker 5 das Differenzsignal K = B - A gebildet wird. In diesem Zustand bildet die Interpolationseinheit 6 einen zweiten absoluten Positionsmesswert P2 innerhalb einer Periode der periodischen Differenzsignale F, K nach der Beziehung P2 = arctan F/K. Dieser zweite Positionsmesswert P2 ist also sozusagen ein synthetisch erzeugter Positionsmesswert P2, der nach einer vom eigentlichen Messbetrieb gemäß Figur 1a abweichenden Verknüpfungsregel der Abtastsignale A, B, C, D erzeugt wird. Auch dieser Positionsmesswert P2 wird der Vergleichseinrichtung 7 zugeführt und dort abgespeichert.

In der Vergleichseinrichtung 7 werden beide Positionsmesswerte P1 und P2 miteinander verglichen und auf Sollabstand geprüft. Im erläuterten Beispiel muss bei korrekter Betriebsweise P2 = P1 – T/4 sein, mit T = Signalperiode der Differenzsignale E, F, K. Wird eine Signalperiode (360°) beispielsweise in 256 gleiche Teile unterteilt (Interpolationsfaktor = 256), dann muss bei einem fehlerfreien Betrieb aller Bauelemente, die zur Erzeugung der Abtastsignale A, B, C, D sowie E, F, K beitragen der Vergleich P2 = P1 – 64 erge-

5

10

15

20

25

30

ben. Liegt dieses Vergleichsergebnis nicht innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereiches, wird ein Fehlersignal R abgegeben.

Der Vorteil der Erfindung ist, dass eine Funktionskontrolle im Stillstand, das heißt ohne Relativbewegung zwischen der Teilung 1 und der Abtasteinheit 3 möglich ist. In die Funktionskontrolle sind alle Bauelemente der einzelnen Abtastkanäle zur Erzeugung der einzelnen Abtastsignale A, B, C, D, E, F, K sowie auch die Interpolationseinheit 6 mit einbezogen.

In den Figuren 2a und 2b ist ein zweites Ausführungsbeispiel dargestellt. Figur 2a zeigt die Positionsmesseinrichtung im normalen Messbetrieb wie gemäß Figur 1a. Die Schalter 81, 82 dienen dazu, um in einem zweiten Zustand die Abtastsignale A und D dem ersten Differenzverstärker 4 zuzuführen, so dass an dessen Ausgang das Differenzsignal A – D = G ansteht und die Abtastsignale C und A dem zweiten Differenzverstärker 5 zuzuführen, so dass an dessen Ausgang das Differenzsignal C – A = H ansteht. In diesem Zustand bildet die Interpolationseinheit 6 einen zweiten absoluten Positionsmesswert P3 innerhalb einer Periode der periodischen Differenzsignale G und H nach der Beziehung P3 = arctan G/H. Dieser zweite Positionsmesswert ist der synthetisch erzeugte Positionsmesswert P3, der nach einer vom eigentlichen Messbetrieb abweichenden Verknüpfungsregel der Abtastsignale A, B, C, D erzeugt wird.

In der Vergleichseinrichtung 7 werden beide Positionsmesswerte P1 und P3 miteinander verglichen und auf Sollabstand geprüft. In diesem zweiten Beispiel muss bei korrekter Betriebsweise P3 = P1 - T/8 sein, mit T = Signalperiode der Differenzsignale G und H. Wird eine Signalperiode (360°) beispielsweise in 256 gleich große Teile unterteilt, dann muss bei einem fehlerfreien Betrieb aller Bauelemente, die zur Erzeugung der Abtastsignale A, B, C, D sowie G und H beitragen der Vergleich P3 = P1 - 32 ergeben.

Das Verfahren zur Funktionskontrolle erfolgt vorzugsweise während der Inbetriebnahme der Positionsmesseinrichtung, es kann aber auch während des Messbetriebes erfolgen, und zwar in Zeiträumen, in denen von einer externen Folgeelektronik keine Positionsmesswerte zur Positionierung eines Maschinenteils angefordert werden. Die erfindungsgemäße Funktionskontrolle erfolgt vorzugsweise innerhalb der Positionsmesseinrichtung.

Bei allen Ausführungsbeispielen können anstelle analoger Abtastsignale A bis H auch digitalisierte Abtastsignale zur Funktionskontrolle dienen.

Zur Erläuterung der Funktionsweise der Erfindung ist die Umschalteinrichtung 8 mit diskreten Schaltern 81 bis 84 dargestellt. In der Praxis wird diese Umschalteinrichtung 8 als Software Bestandteil der Interpolationseinheit 6 sein.

10

15

20

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen lichtelektrischen Positionsmesseinrichtungen beschränkt, sie ist auch bei magnetischen, induktiven sowie kapazitiven Längen- sowie Winkelmesseinrichtungen einsetzbar. Die Erfindung ist nur anhand der Abtastung einer Teilung 1 erörtert. Sie kann selbstverständlich auch bei mehrspurigen absoluten Positionsmesseinrichtungen eingesetzt werden, wobei jede Spur eine periodische Teilung darstellt und die Abtasteinheiten der einzelnen Teilungsspuren gemäß der Erfindung geprüft werden.

Patentansprüche

=========

- 1. Verfahren zur Funktionskontrolle einer Positionsmesseinrichtung mit einer relativ zu einer Teilung (1) verschiebbaren Abtasteinheit (3), wobei die Abtasteinheit (3) mehrere Detektorelemente (3A, 3B, 3C, 3D) besitzt und an einer momentanen Relativlage zwischen Teilung (1) und Abtasteinheit (3) mehrere Abtastsignale (A, B, C, D) erzeugt, wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte aufweist:
 - Bildung eines ersten Positionsmesswertes (P1) aus den Abtastsignalen (A, B, C, D) nach einer ersten Verknüpfungsregel;
 - Bildung eines zweiten Positionsmesswertes (P2; P3) aus den Abtastsignalen (A, B, C, D) nach einer zweiten von der ersten abweichenden Verknüpfungsregel;
 - Vergleich des ersten Positionsmesswertes (P1) mit dem zweiten Positionsmesswert (P1, P2; P1, P3) und
- Erzeugen eines Fehlersignals (R) in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses.

10

15

5

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinheit (3) vier um jeweils 90° gegeneinander phasenverschobene Abtastsignale

$$A = a + \sin \alpha$$

5
$$B = a - \sin \alpha$$

$$C = a + \cos \alpha$$

 $D = a - \cos\alpha \text{ erzeugt.}$

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
 Positionsmesswert (P1) nach folgender Verknüpfungsregel gebildet wird:

P1 = arctan
$$\frac{A-B}{C-D}$$

und dass der zweite Positionsmesswert (P2) nach folgender Verknüpfungsregel gebildet wird:

$$P2 = \arctan \frac{C - D}{B - A}$$

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
 Positionsmesswert (P1) nach folgender Verknüpfungsregel gebildet wird:

P1 =
$$\arctan \frac{A-B}{C-D}$$

und dass der zweite Positionsmesswert (P3) nach folgender Verknüpfungsregel gebildet wird:

P3 = arctan
$$\frac{A-D}{C-A}$$

5. Positionsmesseinrichtung mit

- einer relativ zu einer Teilung (1) verschiebbaren Abtasteinheit (3), wobei die Abtasteinheit (3) mehrere Detektorelemente (3A, 3B, 3C, 3D) besitzt, um an einer momentanen Relativlage zwischen Teilung (1) und Abtasteinheit (3) mehrere Abtastsignale (A, B, C, D) zu erzeugen;
- einer Auswerteeinheit (6) an der die Abtastsignale (A, B, C, D) anliegen und die aus den Abtastsignalen (A, B, C, D) einen Positionsmesswert (P1) nach einer ersten Verknüpfungsregel und einen Positionsmesswert (P2; P3) nach einer zweiten Verknüpfungsregel bildet;
- einer Vergleichseinrichtung (7), der die nach der ersten und zweiten Verknüpfungsregel gebildeten Positionsmesswerte (P1, P2; P3) zugeführt sind und die beide Positionsmesswerte (P1, P2; P1, P3) vergleicht und in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses ein Fehlersignal (R) erzeugt.
- 6. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit eine Interpolationseinheit (6) ist.

20

5

10

15

FIG. 1a

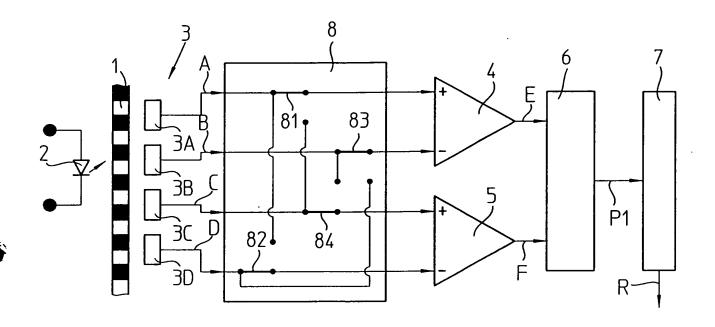


FIG. 1b

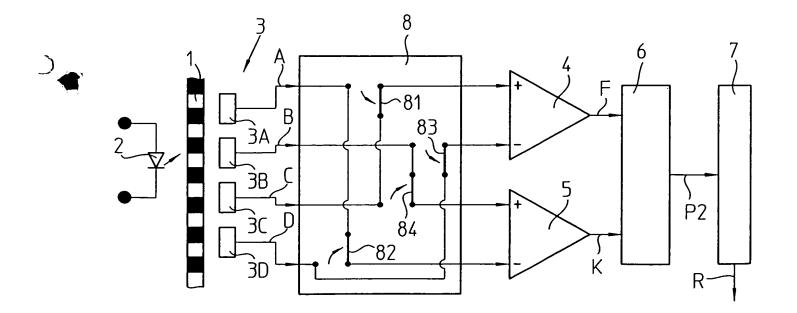


FIG. 2a

>

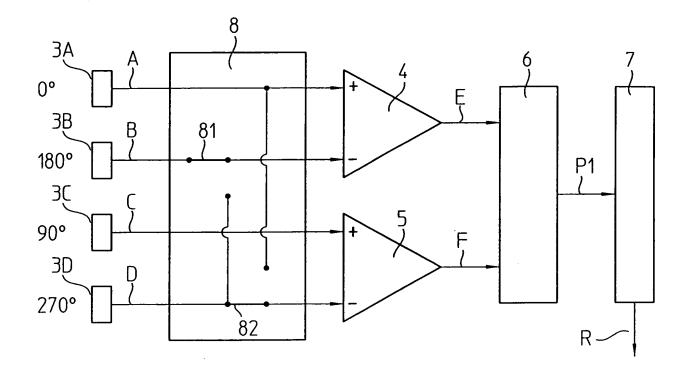


FIG. 2b

